

Загрузка оборудования
УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ
2026 год

План работы центра формируется по мере поступления заявок на проведение измерений от внешних заказчиков (организаций и физических лиц), внутренних заказчиков (подразделений УрФУ), а также на основании плана работ по выполнению исследований в рамках госзадания, проектов и грантов научных фондов, учебного плана ИЕНиМ.

№	Наименование единицы оборудования	Фирма изготовитель	Загрузка оборудования
1.	Комплекс оборудования сканирующей зондовой микроскопии		
	Зондовая нанолaborатория NTEGRA-Aura	ЗАО «НТ-МДТ», Россия, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Зондовая нанолaborатория NTEGRA-Therma	ЗАО «НТ-МДТ», Россия, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Зондовая нанолaborатория NTEGRA-Prima	ЗАО «НТ-МДТ», Россия, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Сканирующий зондовый микроскоп MFP 3D SA	Asylum Research, США, 2013	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Сканирующий зондовый микроскоп-нанотвердомер НаноСкан-4Д	ФГБНУ ТИСНУМ, Россия, 2014	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
2.	Комплекс оборудования конфокальной микроскопии		
	Зондовая нанолaborатория NTEGRA-Spectra	ЗАО «НТ-МДТ», Россия, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Система конфокальной микроскопии комбинационного рассеяния Alpha 300 AR	WiTec, Германия, 2012	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
3.	Комплекс оборудования электронной микроскопии		
	Аналитический комплекс для исследований химических и физических свойств материалов с системой для подготовки образцов и улучшения контраста сканирующей электронной микроскопии и микроанализа Auriga CrossBeam	Carl Zeiss, Германия, 2010	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Микроскоп электронный автоэмиссионный сканирующий Merlin	Carl Zeiss, Германия, 2016	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Сканирующий электронный микроскоп EVO LS 10	Carl Zeiss, Германия, 2014	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Микроскоп электронный сканирующий VEGA 3 SBH	Tescan, Чехия, 2020	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
4.	Комплекс оборудования оптической микроскопии		
	Моторизованный оптический микроскоп для материаловедения с	Olympus, Япония, 2011	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026

	системой автоматического панорамирования Olympus BX61TRF		
	Оптический микроскоп Olympus BX-51 с системой фоторегистрации	Olympus, Япония, 2004	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Оптический профилометр Wyko NT 1100	Veeco Instruments Inc, США, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Двухкоординатная комбинированная система бесконтактных измерений Kestrel-200/Peregrine	Vision Engineering Великобритания, 2010	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
5.	Комплекс оборудования для термического анализа		
	Прибор синхронного DСК/DTA термоанализатор STA 409 PC Luxx	Netzsh, Германия, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Прибор синхронного DСК/DTA термогравиметрический анализатор PYRIS 1 TGA	Perkin-Elmer, США, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Высокотемпературный дилатометр DIL 402C	Netzsh, Германия, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Анализатор площади поверхности и пористости TriStar 3000	Micromeritics, США, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
6.	Комплекс оборудования для хромато-масс-спектрометрии		
	Хромато-масс-спектрометр гибридный квадрупольный Xevo QToF UPLC	Waters, США, 2010	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Газоаналитическая система на основе квадрупольного масс-спектрометра STA 409 Luxx/QMS 403 C	Netzsh, Германия, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
7.	Комплекс оборудования для определения состава материалов		
	Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой iCAP 6500 Duo	Thermo Scientific, США, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Атомно-абсорбционный спектрометр Solaar 6M	Thermo Scientific, США, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Хроматограф жидкостный LC-20AD	Shimadzu, Япония, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Хроматограф газовый Thermo Focus GC	Thermo Scientific, Италия, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
8.	Комплекс оборудования для оптической спектрометрии		
	ИК-Фурье спектрометр Nicolet 6700	Thermo Scientific, США, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Спектрофлуориметр Флюорат-02-Панорама	Люмэкс, Россия, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Двухлучевой прецизионный спектрофотометр Agilent Cary 5000 с приставкой диффузного отражения DTR-8/D-IR	Agilent Technologies Inc., США, 2013 SOL instruments Беларусь, 2023	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026

9.	Комплекс оборудования для анализа состава поверхности		
	Рентгенофлуоресцентный спектрометр на полном внутреннем отражении Nanohunter	Rigaku Corp., Япония, 2010	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Спектрометр рентгеновский фотоэлектронный многофункциональный K-ALPHA	Thermo Fisher Scientific, Великобритания, 2015	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Лазерный анализатор элементного состава LEA – S500	SOL instruments, Беларусь, 2021	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
10.	Комплекс оборудования для магнитометрии		
	СКВИД-магнитометр MPMS XL7	Quantum Design, США, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Магнитометр вибрационный 7407 VSM	Lake Shore Cryotronics, США, 2013	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
11.	Комплекс оборудования для магнитных измерений		
	Измеритель свойств постоянных магнитов Permagraf-L	Magnet Physik GmbH, Германия, 2012	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Магнитооптический Керр-микроскоп Evico	Evico magnetics, Германия, 2015	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Установка автоматизированная для измерения магнитокалорического эффекта MagEq MMS	ПМТиК, Россия, 2015	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Система специализированная измерения параметров PPMS Dyna Cool с опциями	Quantum Design Inc., США, 2016	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Спектрометр электронного парамагнитного и двойного электронно-ядерного резонансов EMX Plus	Bruker, Германия, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
12.	Комплекс оборудования рентгеновской дифрактометрии		
	Дифрактометр порошковый рентгеновский XRD 7000S	Shimadzu, Япония, 2014	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Дифрактометр рентгеновский порошковый EQUINOX 3000	INEL SAS, Франция, 2011	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
13.	Комплекс оборудования измерения физических свойств материалов		
	Электромеханическая испытательная машина для исследования механических свойств материалов AG-50kNXD	Shimadzu, Япония, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Комплекс для измерения физических свойств материалов DMS-1000	Dryogenic, Англия, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
14.	Комплекс оборудования для исследования сегнетоэлектрических материалов		
	Многофункциональная система для измерения и анализа свойств сегнето, пиро, диэлектриков aixPES	aixACCT Systems GmbH, Германия, 2012	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026

	Оптический микроскоп с системой для высокоскоростной видеосъемки Olympus BX-61; FC13	Olympus, Япония, 2011 FastVision, США, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Интерферометрический измерительный комплекс Thorlabs	Thorlabs, США 2014	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Термостолы для оптической микроскопии TS1500EV-7/6; THMS600	Linkam Scientific, Великобритания, 2021	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Зондовая станция ITS150	MPI Corporation, Тайвань, 2023	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
15.	Комплекс оборудования для биоинженерии		
	Тензиометр K100C	KRUSS, Германия, 2023	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Комплекс для изучения поверхностных свойств DSA25S	KRUSS, Германия, 2023	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
16.	Комплекс оборудования для фотолитографии		
	Чистое производственное помещение класса ГОСТ ИСО5	СК РОСТ, Россия, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Установка для нанесения и термической обработки резиста Sawatec SM180-HP250HDMS	Sawatec Solutions, Лихтенштейн, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Установка совмещения фотошаблона и пластины SUSS MJB4	Suss MicroTec, Германия, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Установка для очистки пластин, проявки и удаления резиста OPTIwet St30	SSE, Германия, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Система контроля качества фотолитографии Olympus BX-51	Olympus, Япония, 2018	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Система очистки воды Elix 10	Millipore, Франция, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
17.	Комплекс оборудования для нанесения тонких пленок		
	Комплект вакуумной установки для электронно-лучевого испарения и магнетронного напыления Auto 500 Edwards	BOC Edw., Великобритания, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Комплект вакуумной установки магнетронного распыления АТС Orion 8 UHV	AJA Int. Inc., США, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Установка реактивно-ионного травления Plasmalab 80 plus RIE	Oxford Instruments, Великобритания, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Установка плазменной обработки АТТО	Diener Electronic GmbH, Германия, 2022	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Вакуумное технологическое оборудование ELATO	IZOVAC, Беларусь, 2016	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026

18.	Комплекс оборудования для лазерной обработки материалов		
	Импульсный твердотельный лазер с гармониками Brilliant	Quantel, Франция, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Лазерная система для обработки материалов на базе CO ₂ лазера VL-300/40	ЦЛТ, Россия, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Лазерный стенд фемтосекундных импульсов на базе фемтосекундного лазера ТЕТА-10	Авеста-Проект, Россия, 2021	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Иттербиевый фемтосекундный волоконный лазер ANTAUS-20	Авеста-Проект, Россия, 2023	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
19.	Комплекс оборудования для синтеза коллоидных растворов наночастиц металлов		
	Система прецизионной лазерной маркировки МиниМаркер 2 - M20	ООО «Лазерный центр», Россия, 2017	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Лазерная система для обработки материалов на базе волоконного лазера Fmark-20	ЦЛТ, Россия, 2008	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Анализатор дисперсии наночастиц и растворов универсальный Zetasizer Nano	Malvern Instruments, Великобритания 2009	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Анализатор размеров частиц SALD-7101	Shimadzu, Япония, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Камера инфракрасная H2640 (NEC)	NEC, Япония 2013	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
20.	Комплекс оборудования для прецизионной механической обработки		
	Станок для прецизионной шлифовки и полировки PM5	Logitech, Великобритания, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Алмазная дисковая и проволочная пила Model 15	Logitech, Великобритания, 2007	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Автоматическая установка резки DAAD 3220	DISCO, Япония, 2014	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
21.	Комплекс оборудования для термообработки материалов		
	Высокотемпературная печь ЛНТ 01/17 D/P480	Nabertherm, Германия, 2019	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Печь камерная ЛНТ 08/18	Nabertherm, Германия	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Муфельная электропечь ТК.8-1150.М.1Ф	ООО «НПО «Термокерамика», Россия, 2013	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026
	Компактная трубчатая печь R 50/250/13/C450	Nabertherm, Германия, 2021	Частичная загрузка 12.01.2026 – 30.12.2026